

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成20年5月1日 (2008.5.1)

【公表番号】特表2007-529404(P2007-529404A)

【公表日】平成19年10月25日 (2007.10.25)

【年通号数】公開・登録公報2007-041

【出願番号】特願2007-504048(P2007-504048)

【国際特許分類】

C 0 1 B 31/02 (2006.01)

C 0 9 C 1/44 (2006.01)

C 0 9 C 3/08 (2006.01)

B 0 1 J 31/24 (2006.01)

B 0 1 J 32/00 (2006.01)

C 0 9 K 11/06 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

C 0 1 B 3/00 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 31/02 1 0 1 Z

C 0 9 C 1/44

C 0 9 C 3/08

B 0 1 J 31/24 Z

B 0 1 J 32/00

C 0 9 K 11/06 6 8 0

H 0 5 B 33/14 B

C 0 1 B 3/00 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月11日 (2008.3.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

炭素表面に共有結合した官能基と、該官能基に結合した金属基を含む修飾炭素生成物であって、電気透析、電気導体、イオン導体、免疫測定、エレクトロルミネッセンス、発光、熱伝導性流体、水素貯蔵、触媒反応、キャパシタ及びセンサーからなる群から選択される用途に使用される、修飾炭素生成物。

【請求項 2】

前記金属基が前記官能基にイオン結合している、請求項 1 に記載の修飾炭素生成物。

【請求項 3】

前記金属基が前記官能基に共有結合している、請求項 1 に記載の修飾炭素生成物。

【請求項 4】

a) 炭素担体を用意し、

b) 該炭素担体を官能基で修飾し、及び

c) 金属基を該官能基に結合させる工程を含む、修飾炭素生成物の製造方法。

【請求項 5】

前記炭素担体がカーボンブラックを含む、請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

前記官能基がイオンの電荷を帯びており配位性である、請求項 4 に記載の方法。

【請求項 7】

前記金属基が前記官能基に共有結合している、請求項 4 に記載の方法。

【請求項 8】

前記修飾工程が、前記炭素担体を含む前駆体溶液をスプレー処理する工程を含む、請求項 4 に記載の方法。

【請求項 9】

炭素表面に共有結合した官能基を含み、水素貯蔵、触媒反応、キャパシタ、熱伝導性流体、発光及び電気透析からなる群から選択される用途に使用される、修飾炭素生成物。